# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-011757

(43)Date of publication of application: 21.01.1991

(51)Int.Cl.

H01L 23/29

H01L 21/56 H01L 23/31

(21)Application number: 01-145340

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MICRO COMPUT ENG

LTD

(22)Date of filing:

09.06.1989

(72)Inventor: SATO MASAAKI

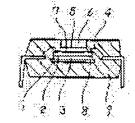
ABE HIRONOBU

IZUMI AKIYA KANEDA AIZO KOIKE SHUNJI

## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve a semiconductor device of this design in humidity resistance and reliability by a method wherein a light transmitting member is fixed by bonding to the outside of the photodetective face of a semiconductor element through the intermediary of a transparent resin layer, and a vacancy is formed between the photodetective face and the light transmitting member.



CONSTITUTION: A solid image sensing device 3 is bonded to a lead frame 1 through an epoxy resin 2, and an Au wire 4 is bonded to the element 3. A light transmitting member 6 of boro-silicate glass whose one side is coated with a semi-cured transparent resin layer 5 is mounted on the device 3. The layer 5 is formed of

semi-cured silicon resin whose reactive groups stay reactive as much as 40% of those in a fully cured state. The layer 5 is heated at a temperature of 150°C for one hour and pressed to

Searching PAJ Page 2 of 2

bond the element 3 to the light transmitting member 6. Moreover, the silicon resin fully covers a photodetective face 7 excluding a bonding pad 8. The assembled body concerned is molded with epoxy resin to form a resin molded body 9. A lead frame part is cut off and fabricated to form a solid-state image sensing device.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### 19 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-11757

30 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月21日

H 01 L 23/29 21/56

6412-5F 6412-5F H 01 L 23/30

F X

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

②特 願 平1-145340

J

②出 願 平1(1989)6月9日

⑩発明者 佐藤 正昭

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑩発明者 阿部

広 伸

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

Þ

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

②出 願 人 日立マイクロコンピュ

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地東京都小平市上水本町5丁目22番1号

ータエンジニアリング

株式会社

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 糾 誉

1. 発明の名称 半導体装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲

  - 2. 請求項1記載の半導体装置において、半導体 素子表面の受光面と透光部材との間に空隙部を ・ 形成したことを特徴とする半導体装置。
  - 3. 請求項1または2記載の半導体装置において、透明樹脂層がシリコーン系樹脂またはエポキシ系樹脂よりなることを特徴とする半導体装置。
  - 4 ・半導体業子表面の受光面の外側に、半硬化した接着用の透明樹脂層を一面に形成した選光部材を、該選光部材が上記半導体業子の受光面の外側に位置するように殺壓し、上記透光部材を半導体業子の受光面に押し圧しながら加熱して、上記光部材を半導体業子の受光面に接着固定す

る工程を有することを特徴とする半導体装置の 製造方法。

- 5. 請求項4記級の半導体装置の製造方法において、半硬化した接着用の透明樹脂層は、シリコーン系樹脂もしくはエポキシ系樹脂によつて構成され、上記透明樹脂層中には末反応基 30~90 %含まれることを特徴とする半導体装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置およびその製造方法に係り 特にEP-ROM(消去、警き込み可能な半導体 記憶素子)、固定繊維素子などのパッケージに窓 を有する半導体装置およびその製造方法に関する。 (従来の技術)

世来の選光部材を有する半導体装置の製造方法は、例えば特別昭58-207656号公報に提案されているように、リードフレームのチップステージ上に半導体素子をダイボンニングし、ワイヤボンディングをした後、透光部材を低粘度のシリコーン

機脂などよりなる透明接着剤を用いて加熱硬化させ上記素子上に接着し固定していた。なお、耐温度サイクル性を向上させるため、接着剤はポンディングパッド部をコートしない構造にしてある。ついで、上記の組立完成体が形成されたリードフレームを機脂モールドした後、リードフレームの切断、成形加工を行い半導体装置を作製していた。(発明が解決しようとする課題)

 り、アルミニウムパッド部へ水分が侵入し路食が発生するものと考えられる。また、接着に用いる透明樹脂は、樹脂中に含まれる異物を除去しクリーンにする必要があるため、透明樹脂が高価格になるという問題もあった。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解消 し、耐湿性に優れた構造の半導体装置およびその 製造方法を提供することにある。

さらに本発明の他の目的は、低価格の半導体装 囮およびその製造方法を提供することにある。

#### (課題を解決するための手段)

上記本発明の目的を遠成するために、半導体素子表面の受光面の外側に、半硬化した接着用の透明樹脂層を一面に形成した透光部材を設透光部材が上記半導体業子の受光面の外側に位置するように 秘密し、上記透光部材を半導体素子の受光面に 押し圧しながら加熱して、上記半硬化状態の透明 樹脂層を硬化させて、上記避光部材を半導体案子の受光面に接着固定するという半導体装置の作製手段を用いるものである。

本発明の半導体装置の製造方法において、半硬化した接着用の透明樹脂層は、シリコーン系樹脂もしくはエポキシ樹脂によって構成され、上記透明樹脂層中には末反応基が30~90 %含まれることが好ましく、さらに末反応基が50~85% 含まれていることが、より好ましい。

上記の方法で作製した本発明の半導体装置は、 半導体素子表面の受光面の外側に、シリコーン系 樹脂もしくはエポキシ系樹脂よりなる透明樹脂層 を介して透光部材を接着固定して設けた構造を有 するものである。

また、本発明の半導体装置において、半導体業 子表面の受光面と遊光部材との間に空線部を形成 させることも可能である。

#### (作用)

接着用の透明樹脂を選光部材に透布し、加熱して半硬化状態にする過程で、透明樹脂層に含まれている低分子の揮発性物質のほとんどが気化するか、または反応により透明樹脂層から除かれる。 また、少量残留した低分子の揮発性物質も半硬化 した高分子のからみあった構造の中に閉じこめられ、選光部材を接着させる加熱硬化時においても外部に出てこない。このため、透明樹脂層中の低分子の揮発性物質によりアルミニウムパッド部が汚染さることがなく、モールド樹脂の密着性が良好となり耐湿性が向上する。

なお、接着用の透明樹脂としては、シリコーン樹脂、エボキシ樹脂等が好適に用いられる。半硬化状態としては、接着時に低分子揮発成分が気化せず、透光部材と十分な密着性を保持する状態が好ましい。また、透明樹脂中の末反応基は30~90%含むものが好ましく、さらに50~85%含むものがより好適である。

そして、透明樹脂層を半導体素子の受光面の外側に形成させる方法として、通常スクリーン印刷 等が用いられる。

#### 〔実施例〕

以下に、本発明の一実施例を挙げ、図面に基づいて、さらに詳細に説明する。第1図は本発明の 半遺体装置の構成の一例を示す断面図である。図 においてリードブレーム1に、エポキシ樹脂2によって固体協像親子3を接着し、Au(金)線4をポンディングする。その固体過級親子3上に、第2回に示す半硬化の透明樹脂層5を一面に形成したホウケイ酸系ガラスからなる透光部材6を収置する。透明樹脂層5はシリコーン系樹脂を用いており、完全硬化の状態に対し40%の反応基が反応している半硬化樹脂である。これを押し圧して、150 ℃で1時間加熱して固体協像親子3と透光部材6とを接着させる。なお、シリコーン系樹脂は 受光面7を完全に被置し、ポンディングパッド8 は被置しない機造とする。

次に、上記の手順で作製したリードフレーム 構造品を、成形金型に設置して、トランスファモールド法により、エポキシ系樹脂を用いてモールドし、モールド樹脂 9 を形成させる。そして、リードフレーム部の切断、成形加工を行い固体 最 像 装置を作製した。

次に、本発明の他の実施例を第3回に示す。上 記の第1回に示す実施例と同様の工程によって過

第1回は本発明の実施例において例示した固体 最後装置の断面構造を示す模式図、第2回は第1 図の要部拡大図で半硬化の透明樹脂接着層を設け た透光部材を示し、第3回は本発明の他の実施例 である固体最低装置の断面構造を示す模式図である。

1…リードフレーム 2…エポキシ樹脂

3 … 固体最级景子 4 ·

k 梨子 4 ··· ku (金) 條

5 … 透明樹脂層 6 … 透光部材

7…受光面 8…ポンディングパット

9 … モールド樹脂 10 … 空隙部

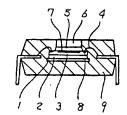
上記の実施例によって作製した2種の固体機像 装置を、80℃、95%RH影開気中に2000 時間放置 したが、いずれも特性劣化はほとんど見られず、 優れた耐湿性を示した。

#### (発明の効果)

以上詳細に説明したごとく、本発明の方法により作製した半導体装置は、加熱硬化して透光部材を接着固定させる半硬化の透明樹脂層からの低分子揮発性物質の発散をほぼ完全に防止することができるので、アルミニウムパッド部などが汚染されることなく、モールド樹脂の密着性が一段と向上するので、極めて耐湿性に優れた信頼性の高いレジンモールド協体最像装置やEPーROM装置などの半導体装置が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

### 第 1 区



1…リードフレーム 2…エは体環像素3 4…Au(金)線 5…透光光面 6…逆光光面 8…ポンディングパット 9…モールド樹脂

第 2 図

6 透光部材 ) 5 透明樹脂層 第 3 区

/0-空隙部

**C**理人弁理士 小 川 勝 男

第1頁の続き . 動Int. Cl. <sup>5</sup> H 01 L 21/56 23/31					識別記号	R	庁内整理番号 6412-5F
•		23	3/31				
個発	明	者	泉		章	也	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場
@発	明	者	金	田	愛	=	内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
⑫発	明	者	小	池	俊	=	東京都小平市上水本町5丁目22番1号 日立マイクロコン ビュータエンジニアリング株式会社内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.